

プラズマチーム

<氏名> 小木曾 久人

<役職> チームリーダー

<所属> 産業技術総合研究所

<開発内容>

プラズマチームでは、プラズマによるドライエッチング装置とスパッタ成膜装置の開発を行っています。ミニマルファブに適した小型で高効率なプラズマ発生源を開発するとともに、真空排気系や電源など、従来からあまり小型化が進んでいないプラズマ装置の構成要素も小型化をはかり、ミニマルファブのコンセプトにあった、スマートなプラズマプロセス装置の開発を目指します。

<自己紹介>

1985年工業技術院機械技術研究所入所、1993年工業技術院産業技術融合領域研究所、2001年産業技術総合研究所、現在に至る。超先端加工プロジェクト(1986-1993)、アトムテクノロジープロジェクト(1992-2002)、ナノレベル電子セラミックス材料低温成形・集積化プロジェクト(2002-2007)などに参画。

イオンビームプロセス、走査型プローブ顕微鏡の研究などに取り組んできた。

<氏名> 中野 禅

<役職> サブリーダー

<所属> 産業技術総合研究所

<開発内容>

プラズマ技術利用のミニマル装置開発を進めています。とはいえプラズマ装置は多岐に渡るため、まずエッチング装置、スパッタ装置から開発を進めています。

<自己紹介>

機械技術研究所(現産総研)に入所後、マイクロマシンプロジェクト等を通しMEMSデバイス開発などを実施。特にイオン注入を用いた材料改質型のMEMSデバイスやプラズマ表面処理を行ったデバイス開発を行う。一方MEMS製品と製造装置のバランスの悪さを解消するためにミニマルマニュファクチャリング開発も進める。機械工学のベースから筐体やドッキングステーションなども装置面を考慮しながら開発を進めています。